

Plataforma de Nanotecnología

Solicitud de Alta de Usuario Vinculado al Cliente

DATOS DEL USUARIO*:

Nº DE USUARIO:

Nº DE CLIENTE:

**Persona que está vinculada a un CLIENTE que asume el coste derivado de la prestación de servicios realizados en la Plataforma.*

Nombre y Apellido del Cliente:	
Instituto, Centro o Empresa:	
Departamento / Laboratorio:	
Nombre y Apellido del Usuario:	
DNI:	
Nº Tarjeta PCB (sólo para usuarios del PCB):	
Cargo del Usuario:	
Teléfono de contacto:	
E-mail:	

Firma del Cliente, sello de la Institución y fecha:

CONDICIONES GENERALES.

La firma de este documento conlleva:

- 1.- Que el usuario/a ha leído la documentación correspondiente a la normativa y condiciones de uso de la Plataforma de Nanotecnología. <http://www.ibecbarcelona.eu/services/nanotechnology-platform/>
- 2.- El usuario deberá citar la Plataforma de Nanotecnología en las publicaciones que deriven del servicio prestado.

3.- El IBEC no se hace responsable de los daños materiales y/o personales derivados del mal uso de las instalaciones y/o incumplimiento de las normas de seguridad y del plan de emergencia del edificio.

4.- El incumplimiento de estas normas conlleva a la pérdida de los derechos de uso de los equipos e instalaciones de la Plataforma de Nanotecnología.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos personales facilitados voluntariamente en el presente formulario serán incorporados y/o actualizados en un fichero automatizado titularidad de la FUNDACIÓN INSTITUTO DE BIOINGENIERÍA DE CATALUÑA (IBEC), con domicilio social en C/ Baldiri Reixac, 10-12, 08028 Barcelona cuya finalidad es gestionar la prestación de servicios, la difusión de formación y seminarios.

En cualquier momento, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando un correo electrónico a la dirección arco@ibecbarcelona.eu.

Doy consentimiento a recibir información científico-técnica así como de la realización de formación y seminarios que organice el IBEC mediante correo electrónico. **SI** **NO**

Seleccione los equipos/instalaciones que desea utilizar:

Time-of-the-Flight Ion Mass Spectroscopy (ToF-SIMS)	
Ultra-High Resolution Field Emission Scanning Electron Microscopy (SEM)	
E-beam Lithography (EBL)	
Nanoimprint Lithography (NIL)	
UV-Photolithography - Mask-aligner	
Direct Write Laser Lithography	
Thermal and E-beam metal evaporator	
Reactive Ion Etching (RIE)	
Inteferometer	
Profilometer	
Chemical Bath	
Spinner	
Plasma Cleaner	
Optical microscope	
Oven	
UV Curing Lamp System	
Microarrayer	
Contact Angle	
Clean room	